AlGaN/GaN ヘテロ構造の光電気化学特性と低損傷加工技術への応用

Study on photo-electrochemical response property of AlGaN/GaN hetero-structure and its application to low damage etching technology

北大量集セ [○]熊崎 祐介, 植村 圭佑, 佐藤 威友 RCIQE, Hokkaido Univ. [○]Yusuke Kumazaki, Keisuke Uemura and Taketomo Sato Phone: 011-706-7172 / E-mail: kumazaki@rciqe.hokudai.ac.jp

【はじめに】 AlGaN/GaN-HEMT のゲートリセス化は、ノーマリオフ動作実現や相互コンダクタンス 改善に有望な手法である [1, 2]。この構造では、ゲート直下のみの AlGaN を薄層化する必要があり、 低損傷で制御性に優れた加工技術が求められる。この要請に対し、電気化学エッチングは窒化物半導 体の低損傷加工に有望な技術 [3] であるが、AlGaN/GaN ヘテロ構造へ適用された例は非常に少なく、 制御性に関する議論はまだまだ不十分である。そこで本研究では、電気化学反応におけるキャリア供 給過程に注目し、制御性向上に関する検討をおこなった。

【実験】 図1に実験で使用した試料の模式図を示す。エッ チング対象となるAlGaN層は25 nmとした。オーミック電極 は2DEGに形成し、保護マスクとしてSiO₂をスパッタリング により成膜した。電気化学プロセスは、3電極式の電気化学 セルを用い、硫酸と燐酸の混合溶液中でおこなった。まず AlGaN/GaNへテロ構造の電気化学特性を評価するため、リニ アスイープボルタンメトリを適用した。次に種々の電気化学 条件によりエッチングし、キャリア供給過程がエッチングに 与える影響を調査した。

図2に、暗中もしくは単色光を AlGaN 側 【結果と考察】 から照射した際の電極電位 VEC に対する電流密度を示す。負 電流は、すべての条件において-0.8 V付近を閾値として流れ ている。これは、負電圧の印加により AlGaN 障壁が小さく なり、2DEGから電解液に電子が供給されることに起因する。 正方向に電極電位を掃引した際、暗中および λ = 400 nm の光 照射下においてはほとんど電流が見られない。図3は(i)VFC =0Vおよび(ii)V_{EC}=3Vにおける AlGaN/GaN ヘテロ構造の ポテンシャル分布である。暗中及びλ=400 nmの光照射下で は正電圧印加時において AlGaN/電解液界面へキャリアが供 給されないため、電流が流れないと考えられる。一方、GaN 層で選択的に吸収されるλ=360 nmの光照射下では1V以上 の電極電位において正電流が観測された。この原因として、 V_{EC} = 0 V 付近(図3(i)) では GaN 層で発生する光励起キャ リアが分離されず再結合するが、正電圧印加時(図3(ii)) には正孔が AlGaN 層を超えて電解液に供給されることが考 えられる。これに対し、AlGaN層においても吸収される λ= 300 nm の光照射下では、V_{EC} = 0 V 付近においてもキャリア 分離されるため電流が観測されたと考えられる。発表当日は、 種々の電気化学条件によりキャリア供給過程を制御し、電気 化学エッチングに与える影響を議論する。

Reference

- [1] Y. Ohmaki *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **45** (2006) L1168-L1170.
- [2] A. Endoh *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **43** (2004) L2255-L2258.
- [3] T. Sato et al., Proc. SPIE 9748 (2016) 97480Y.

SiO₂ mask Ohmic contact i-AlGaN : 25 nm i-GaN : 1000 nm buffer Si substrate

Fig. 1. Schematic illustration of a sample structure with AlGaN/GaN hetero-junction.







Fig. 3. Potential distribution of AlGaN/GaN hetero-structure with $V_{\rm EC}$ of (i) 0 V and (ii) 3 V. Expected behavior of photo-excited carriers is schematically illustrated.